Docket No. 251241US2/vdm

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

					∖œ.
IN RE APP	LICATION OF: Katsufumi EHATA		GAU:	2855	PADEMAP
SERIAL NO: 10/812,887		EXAMINER:			
FILED:	March 31, 2004				
FOR:	METHOD AND APPARATUS FOR MEAS DIELECTRIC	SURING COMPLE	EX DIELECTR	UC CONSTAI	NT OF
	REQUEST I	OR PRIORIT	Ϋ́		
	IONER FOR PATENTS DRIA, VIRGINIA 22313				
SIR:					
	nefit of the filing date of U.S. Application Seria ons of 35 U.S.C. §120.	al Number ,	filed , is	claimed pursu	ant to the
☐ Full ber §119(e)	nefit of the filing date(s) of U.S. Provisional Application No.		imed pursuant t Date Filed	to the provisio	ons of 35 U.S.C.
	ants claim any right to priority from any earlier visions of 35 U.S.C. §119, as noted below.	filed applications	to which they i	may be entitled	d pursuant to
In the matte	er of the above-identified application for patent	, notice is hereby g	given that the a	pplicants clain	n as priority:
COUNTRY Japan	2003-096424	<u>NUMBER</u>	March 31,		
Japan	2003-283591 2003-283592		July 31, 20 July 31, 20		
Japan Japan	2003-283592		July 31, 20		
Japan	2004-059742		March 3, 2		
are	opies of the corresponding Convention Applicates submitted herewith be submitted prior to payment of the Final Fee				
	e filed in prior application Serial No. file				
□ wer Rec	e submitted to the International Bureau in PCT eipt of the certified copies by the International nowledged as evidenced by the attached PCT/I	Application Num Bureau in a timely	ber ⁄ manner under	PCT Rule 17	.1(a) has been
□ (A)	Application Serial No.(s) were filed in prior ap	pplication Serial N	o. filed	; and	
□ (B)	Application Serial No.(s)				
	are submitted herewith				
	will be submitted prior to payment of the Fig	nal Fee			
		Resp	ectfully Submi	tted,	
			ON, SPIVAK, ER & NEUSTA		ND,

Customer Number

22850

Tel. (703) 413-3000 Fax. (703) 413-2220 (OSMMN 05/03) Registration No. 24,913

Joseph A. Scafetta, Jr. Registration No. 26, 803



別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed ith this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月31日

出 願 番 号 Application Number:

特願2003-096424

ST. 10/C]:

[JP2003-096424]

願 人 plicant(s):

TDK株式会社

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office

4 月

2004年

可能

CERTIFIED COPY OF PRIORITY DOCUMENT

【書類名】

特許願

【整理番号】

99P05069

【提出日】

平成15年 3月31日

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G01R 27/06

【発明の名称】

粉体の比誘電率の測定方法、粉体の比誘電率を比較する

方法および比誘電率の測定装置

【請求項の数】

11

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区日本橋一丁目13番1号 ティーディーケ

イ株式会社内

【氏名】

江畑 克史

【特許出願人】

【識別番号】

000003067

【氏名又は名称】

ティーディーケイ株式会社

【代理人】

【識別番号】

100081411

【弁理士】

【氏名又は名称】

三澤 正義

【電話番号】

03-3361-8668

【手数料の表示】

【予納台帳番号】

007984

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】

要

【書類名】 明細書

【発明の名称】 粉体の比誘電率の測定方法、粉体の比誘電率を比較する方法および比誘電率の測定装置

【特許請求の範囲】

【請求項1】 導波路内に比誘電率を測定すべき粉体を入れる段階と、

前記導波路内に電磁波を入射させて、その電磁波の応答により前記導波路内の 前記粉体と、気体または液体とからなる混合体の比誘電率を測定する段階と、

前記混合体の比誘電率と前記混合体における前記粉体の体積比率とから前記粉体の比誘電率を算出する算出段階と、

を含むことを特徴とする粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項2】 前記算出段階では、下式:

logε= v_1 logε $_1+v_2$ logε $_2$ ただし、

ε:混合体の比誘電率

ε 1:気体または液体の比誘電率

ε 2:粉体の比誘電率

v₁:気体または液体の体積比率

v 2:粉体の体積比率

を用いることにより、前記粉体の比誘電率を算出することを特徴とする請求項 1記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項3】 前記算出段階では、下式:

 $\varepsilon^{k} = v_{1} \varepsilon_{1}^{k} + v_{2} \varepsilon_{2}^{k}$

ε:混合体の比誘電率

ε 1:気体または液体の比誘電率

ε 2:粉体の比誘電率

v₁:気体または液体の体積比率

v 2:粉体の体積比率

を用いることにより、前記粉体の比誘電率を算出することを特徴とする請求項 1記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項4】 前記算出段階では、下式:

 $1/(\varepsilon+u) = v_1/(\varepsilon_1+u) + v_2/(\varepsilon_2+u)$ ただし、

ε:混合体の比誘電率

ε 1:気体または液体の比誘電率

ε 2:粉体の比誘電率

v 1:気体または液体の体積比率

v 2:粉体の体積比率

u:フィッティングパラメータ (0≤u)

を用いることにより、前記粉体の比誘電率を算出することを特徴とする請求項 1記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項5】 前記導波路は、同軸型導波路であることを特徴とする請求項1 乃至請求項4のいずれかに記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項6】 前記導波路は、方形導波管型導波路であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項7】 前記導波路は、円形導波管型導波路であることを特徴とする請求項1乃至請求項4のいずれかに記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項8】 前記導波路は、前記気体または前記液体を保持するシール部を備えたことを特徴とする請求項1乃至請求項7のいずれかに記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項9】 前記混合体における前記粉体の体積比率が0.32~0.42 に設定されるとともに、前記電磁波の周波数が0.1GHz以上であることを特徴とする請求項1乃至請求項8のいずれかに記載の粉体の比誘電率の測定方法。

【請求項10】 粉体と、気体と液体とからなる複数種の混合体であり、前記 粉体の種類が異なりかつ体積比率が同一である各々の混合体を、それぞれ導波路 にいれ、前記導波路に電磁波を入射させその電磁波の応答により、前記混合体の 比誘電率をそれぞれ測定し、各混合体の比誘電率の大きさを比較することにより 、複数の粉体の比誘電率を比較する方法。

【請求項11】 比誘電率を測定すべき粉体と、気体または液体とからなる混合体が内部に充填された際に前記混合体を保持するシール部を備えた導波路を含む比誘電率の測定装置。

【発明の詳細な説明】

 $[0\ 0\ 0\ 1]$

【発明の属する技術分野】

本発明は、誘電体物質の誘電特性評価法に関し、特に、粉体状の誘電体物質の 誘電特性を高周波で評価する方法、複数の粉体の比誘電率を比較する方法および 比誘電率の測定装置に関する。

 $[0\ 0\ 0\ 2\]$

【従来の技術】

各種無線装置の需要増に伴い、より高性能な高周波用セラミックス誘電体が求められている。一般に、セラミックス誘電体は、その粉体状の材料を焼成することにより得られた焼成品の状態で使用されるか、そのまま粉体の状態で使用される。また、これらと樹脂などとを種々の比率で混合して誘電率を変化させた複合誘電体が回路部品として用いられる。従って、高周波用セラミックス誘電体の開発においては、その誘電特性を粉体の状態で評価する技術が求められている。

[0003]

従来においては、一定の間隔を置いて対向する1対の電極が配置された容器内に、比誘電率を測定すべき粉体を入れ、電極間に電圧を加えて、粉体と空気の混合体の比誘電率を測定していた。そして、測定した比誘電率に対数混合則またはリヒトネッカロータの式を適用して粉体の比誘電率を求めていた(例えば、特許文献1)。また、液体を使用して、粉体と液体との混合体の比誘電率を測定し、測定した比誘電率に対数混合則などの式を適用して粉体の比誘電率を求めていた(例えば、特許文献2)。

 $[0\ 0\ 0\ 4]$

【特許文献1】

特許第3246001号(段落 [0012] - [0018]、図1)

【特許文献2】

特許第3127623号(段落 [0012] - [0018]、図1)

[0005]

【発明が解決しようとする課題】

しかしながら、従来技術において使用されている測定装置では、集中定数回路が形成されるため、測定周波数における波長に比べて測定装置を十分に小さくする必要があった。従って、 $1\,\mathrm{MH}\,z$ 程度の周波数領域で測定することは可能であったが、数 $G\,\mathrm{H}\,z$ 以上の周波数領域では測定できなかった。これは、測定装置を十分に小さくすることができなかったからである。

[0006]

本発明は、上記の問題を解決するものであり、測定すべき粉体を分布定数回路が形成される導波路内に入れ、導波路に入射される電磁波の応答により気体または液体と、粉体との混合体の比誘電率を測定することにより、数GHz以上の高い周波数においても粉体の比誘電率を測定することができる方法を提供するものである。また、気体または液体と、粉体との混合体を使用して粉体の比誘電率を測定する場合に、混合体が導波路から漏れ出さないで粉体の比誘電率を測定することができる、粉体の比誘電率の測定方法を提供するものである。さらに、その測定方法に使用される比誘電率の測定装置を提供するものである。

[0007]

また、混合体の混合率と混合体の比誘電率を、対数混合則またはリヒトネッカロータの式などに入れることにより、粉体の比誘電率を算出することができる方法を提供するものである。

[0008]

さらに、一定の混合比における混合体の比誘電率を算出することにより、異なる試料間の比誘電率の大小を比較する方法を提供するものである。

[0009]

【課題を解決するための手段】

本発明は、導波路内に比誘電率を測定すべき粉体を入れる段階と、前記導波路内に電磁波を入射させて、その応答により前記導波路内の前記粉体と、気体また

は液体とからなる混合体の比誘電率を測定する段階と、前記混合体の比誘電率と前記混合体における前記粉体の体積比率とから前記粉体の比誘電率を算出する算出段階と、を含む粉体の比誘電率の測定方法であることを特徴とするものである

[0010]

さらに本発明は、算出段階において、下式:

logε= v_1 logε $_1+v_2$ logε $_2$ ただし、

ε:混合体の比誘電率

ε 1:気体または液体の比誘電率

ε 2:粉体の比誘電率

v₁:気体または液体の体積比率

v 2:粉体の体積比率

を用いることにより、粉体の比誘電率を算出することを特徴とするものである

$[0\ 0\ 1\ 1]$

さらに本発明は、算出段階において、下式:

 ε $k = v_1 \varepsilon_1 k + v_2 \varepsilon_2 k$

ただし、

ε:混合体の比誘電率

ε 1:気体または液体の比誘電率

ε 2:粉体の比誘電率

v 1:気体または液体の体積比率

v 2:粉体の体積比率

 $k: \forall \forall x \in \mathbb{Z}$

を用いることにより、粉体の比誘電率を算出することを特徴とするものである

[0012]

さらに本発明は、算出段階において、下式:

 $1/(\varepsilon+u) = v_1/(\varepsilon_1+u) + v_2/(\varepsilon_2+u)$ ただし、

ε:混合体の比誘電率

ε 1:気体または液体の比誘電率

ε 2:粉体の比誘電率

v₁:気体または液体の体積比率

v 2:粉体の体積比率

 $u: \mathcal{I} = \mathcal{I}$

を用いることにより、粉体の比誘電率を算出することを特徴とするものである

[0013]

また本発明に使用される導波路は、同軸型導波路であることを特徴とするものである。

[0014]

また本発明に使用される導波路は、方形導波管型導波路であることを特徴とするものである。

[0015]

また本発明に使用される導波路は、円形導波管型導波路であることを特徴とするものである。

[0016]

さらに本発明に使用される導波路は、気体または液体を保持するシール部を備 えたことを特徴とするものである。

[0017]

また本発明の粉体の比誘電率の測定方法において、混合体における粉体の体積 比率が 0.32~0.42に設定されるとともに、電磁波の周波数が 0.1 G H z 以上であることを特徴とするものである。

[0018]

さらに本発明は、粉体と、気体と液体とからなる複数種の混合体であり、前記 粉体の種類が異なりかつ体積比率が同一である各々の混合体を、それぞれ導波路 にいれ、前記導波路に電磁波を入射させその電磁波の応答により、前記混合体の 比誘電率をそれぞれ測定し、各混合体の比誘電率の大きさを比較することにより 、複数の粉体の比誘電率を比較する方法であることを特徴とするものである。

[0019]

さらに本発明は、比誘電率を測定すべき粉体と、気体または液体とからなる混合体が内部に充填された際に混合体を保持するシール部を備えた導波路を含む比誘電率の測定装置であることを特徴とするものである。

[0020]

【発明の実施の形態】

以下、本発明の実施の形態について、図1乃至図16を参照しつつ説明する。図1乃至図12は、本発明の第1の実施形態における粉体の比誘電率の測定方法に関する図である。図13は、本発明の第2の実施形態における粉体の比誘電率の測定方法に関する図である。図14は、第1および第2の実施形態において測定された粉体の比誘電率に関する図である。図15は、本発明の第3の実施形態における粉体の比誘電率の測定方法に関する図である。図16は、本発明の実施形態おける誘電特性測定装置の構成を示すブロック図である。

$[0\ 0\ 2\ 1]$

図1は、本発明の第1の実施形態にて測定装置として使用される同軸型導波路10の斜視図である。図2乃至図4は、第1の実施形態の同軸型導波路10を用いて測定された複合体の比誘電率の実測値と、その実測値に計算式を適用した結果を示す図である。図5乃至図7は、粉体の比誘電率を算出するために用いるグラフである。図8乃至図10は、各粉体の比誘電率を示す表である。図11は比誘電率の周波数依存性について測定した結果である。図12は、異なる材料の粉体の比誘電率の大きさを相対比較した表である。

[0022]

図13は、本発明の第2の実施形態にて測定装置として使用される方形導波管型導波路20の斜視図である。また、図14は、第2の実施形態の方形導波管型導波路20を用いて得られた混合体23の比誘電率と、第1の実施形態の同軸型導波路10を用いて得られた混合体13の比誘電率とを比較したグラフを表して

いる。

[0023]

図15は、本発明の第3の実施形態にて測定装置として使用される円形導波管 型導波路30の斜視図である。

[0024]

図16は、本発明の実施形態において使用される誘電特性測定装置100の構成を表したブロック図である。この図16を参照しつつ、この誘電特性測定装置100について説明する。同図に示すように、誘電特性測定装置100は、導波装置101と、測定手段102とを含む。導波装置101には、本発明の実施形態において使用される導波路が使用される。また、測定手段102は、ネットワークアナライザー103と、演算処理装置104とを含んでいる。この測定手段102は、導波装置101を励振させると共に、導波装置101の出力信号を解析する。

[0025]

ネットワークアナライザー103は、導波路で構成されている導波装置101 に入力する電磁波を発生させ、導波装置101から供給されたアナログデータを デジタル処理する。また、演算処理装置104は、ネットワークアナライザー1 03から供給されるデジタルデータを取り込み、誘電特性測定および出力のため の処理を行う。

[0026]

次に、誘電特性測定装置 100を用いた誘電特性測定方法を説明する。ネットワークアナライザー103から導波装置 101に高周波電磁波を入射して、導波装置 101を励振させる。そして、導波装置 101の透過波および反射波をネットワークアナライザー103 に供給する。ネットワークアナライザー103からの出力データを演算処理装置 104に取り込み、混合体の比誘電率を計算する。

[0027]

このようにして得られた粉体と、気体または液体との複合体の比誘電率 ϵ を、対数混合則、リヒトネッカロータの式またはウイナーの式のような混合材料の比誘電率を算出する式に適用して、粉体の比誘電率を算出する。ここで、これらの

式について説明する。

[0028]

対数混合則は次に示す式によって表される。

[0029]

 $l \circ g \varepsilon = v_1 l \circ g \varepsilon_1 + v_2 l \circ g \varepsilon_2$

また、リヒトネッカロータの式は次のように表される。

[0030]

 $\varepsilon^{k} = v_{1} \varepsilon_{1}^{k} + v_{2} \varepsilon_{2}^{k}$

また、ウイナーの式は次のように表される。

[0031]

 $1 / (\varepsilon + u) = v_1 / (\varepsilon_1 + u) + v_2 / (\varepsilon_2 + u)$

ここで、

ε:混合体の比誘電率

ε 1:気体または液体の比誘電率

ε 2:粉体の比誘電率

v 1:気体または液体の体積比率

v 2:粉体の体積比率

 $k: \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}}} \texttt{\textit{T}} \texttt{\textit{T}}$

u:フィッティングパラメータ $(0 \le u)$

[0032]

これらの式が用いられることにより、粉体の比誘電率 ϵ 2 が計算される。例えば気体として空気を使用して、粉体と空気との混合体の比誘電率 ϵ から粉体の比誘電率 ϵ 2 を求める場合、これらの式において空気の比誘電率 ϵ 1 は「1.0」と既知であり、また、空気の体積比率 v 1 および粉体の体積比率 v 2 は、それぞれ導波路の空間に入れる粉体の量により決まる。従って、粉体と空気の混合体の比誘電率 ϵ δ がわかれば、粉体の比誘電率 δ δ を求めることができる。

[0033]

次に、本発明の実施の形態について説明する。まず、第1の実施の形態について説明する。

[0034]

[第1の実施の形態]

(構成)

図1を参照しつつ、本発明の第1の実施形態において使用される導波装置について説明する。同図に示されているように、第1の実施形態に使用される導波装置には同軸型導波路10が用いられている。この同軸型導波路10は、内部が空洞となっている円筒型の外部導体11と、その外部導体11の内部の中心部分に配置されている円柱状の中心導体12とから構成されている。この第1の実施形態における同軸型導波路10の具体的な寸法は、外部導体11の内径が7.00mmで中心導体12の直径が3.04mmとなっている。そして、測定対象となる粉体と、気体または液体との混合体13は、外部導体11と中心導体12との間に入れられることにより、同軸型導波路10の内部に充填される。尚、第1の実施形態においては、気体として空気を使用した。従って、混合体13は、測定すべき粉体と空気とからなる。また、本実施形態においては、同軸型導波路10の内部に充填された状態での混合体13の厚さは約20mmとなる。

[0035]

尚、空気と異種の気体(例えばAr ガス、 N_2 ガス)または液体を使用して、その気体または液体と、粉体とからなる混合体 1 3 の比誘電率 ϵ を測定する場合は、その気体または液体が外部導体 1 1 と中心導 1 2 との間から流れ出さないように、同軸型導波路 1 0 にその気体または液体を保持するためのシール部が設けられる。

[0036]

以上の同軸型同波路 10 を用いて測定する試料として、本実施形態においては、3種類のセラミックス材料($A12O_3$ セラミックス、Ba(MgTa) O_3 セラミックス、 TiO_2 セラミックス)の粉体を用意した。そして、各粉体と空気との混合体 13 を作製し、前述した誘電特性測定装置 100 を用いて各粉体と空気との混合体 13 の比誘電率を測定した。また、後述する第 2 の実施形態の方形導波管型導波路 20 を用いて混合体の比誘電率を測定した結果と比較するために、Ba(Nd, Bi)2 Ti5 O1 4 セラミックスについても測定した。この

比較した結果については第2の実施形態について説明する際に説明する。この第 1の実施形態においては、周波数が5 G H z の電磁波を各混合体 1 3 に入射させ、その応答により比誘電率を測定した。混合体 1 3 における粉体の体積比率を 0 . 3 2 ~ 0 . 4 2 の間で変化させ、各混合体 1 3 の比誘電率を測定した。

[0037]

このようにして得られた粉体と空気との混合体13の比誘電率 ε が、前述した対数混合則、リヒトネッカロータの式またはウイナーの式に適用される。図2乃至図4に、第1の実施形態の同軸型導波路10を用いて測定された各混合体13の比誘電率の実測値と、その実測値に計算式を適用した結果を示す。これらの図に示されている曲線は、混合体13の比誘電率の各実測値を最小二乗法により各式にフィッティングさせて求めたものである。図2は、各混合体13の比誘電率の実測値と、その実測値に対数混合則を適用した結果を示す図である。図3は、各混合体13の比誘電率の実測値と、その実測値にリヒトネッカロータの式を適用した結果を示す図である。図4は、各混合体13の比誘電率の実測値と、その実測値にウイナーの式を適用した結果を示す図である。

[0038]

そして、この測定結果を用いることにより粉体自体の比誘電率を類推することができる。図 5 乃至図 7 に、粉体の比誘電率を類推するためのグラフを示す。この粉体の比誘電率を類推するために、前述した対数混合則などの式を使用し、混合体 1 3 の比誘電率の各実測値を最小二乗法により各式にフィッティングさせて、粉体の比誘電率を類推するための曲線を算出した。そして、粉体の体積比率が「1. 0」のときの空気と粉体との混合体の比誘電率 ε を算出することにより、空気と粉体の混合体における空気の存在を無視して、粉体自体の比誘電率 ε 2 を類推することができる。

[0039]

図5は、各混合体13の比誘電率の実測値を最小二乗法により混合対数則にフィッティングさせた結果を示す図である。図6は、各混合体13の比誘電率の実測値を最小二乗法によりリヒトネッカロータの式にフィッティングさせた結果を示す図である。図7は、各混合体13の比誘電率の実測値を最小二乗法によりウ

イナーの式にフィッティングさせた結果を示す図である。これらの図において、 粉体の体積比率が「1.0」の比誘電率の値を読み取ることにより粉体自体の比 誘電率を類推することができる。そして、図5乃至図7から求めた各粉体の比誘 電率を図8乃至図10にまとめて示す。

[0040]

図8乃至図10は、図5乃至図7で示されている各式を適用して得られた各粉体の比誘電率と、焼結品の比誘電率とを比較した表である。図8は、実測値に対数混合則を適用して得られた各粉体の比誘電率を示す表である。図9は、実測値にリヒトネッカロータの式を適用して得られた各粉体の比誘電率を示す表である。図10は、実測値にウイナーの式を適用して得られた各粉体の比誘電率を示す表である。

[0041]

図8に示すように対数混合則を適用した結果、 $A1_2O_3$ セラミックスの焼結品の比誘電率は「11」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「14.1」となった。また、 $Ba(MgTa)O_3$ セラミックスの焼結品の比誘電率は「24」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「33.9」となった。また、 TiO_2 セラミックスの焼結品の比誘電率は「104」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「185.81となった。

[0042]

また、図9に示すようにリヒトネッカロータの式を適用した結果、A12O3 セラミックスの焼結品の比誘電率は「11」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「15.7」となった。また、Ba(MgTa)O3セラミックスの焼結品の比誘電率は「24」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「19.4」となった。また、 TiO_2 セラミックスの焼結品の比誘電率は「104」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「28.2」となった。

[0043]

また、図10に示すようにウイナーの式を適用した結果、AloOaセラミッ

クスの焼結品の比誘電率は「11」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「8.75」となった。また、Ba(MgTa) O_3 セラミックスの焼結品の比誘電率は「24」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「42.7」となった。また、 TiO_2 セラミックスの焼結品の比誘電率は「104」であるのに対し、本発明の測定方法によって得られた結果は「152.3」となった。

[0044]

以上の結果より、この第1の実施形態における同軸型導波路10を用いることにより、5GHzの周波数で粉体と空気とからなる混合体の比誘電率を測定することができ、さらに、その結果から粉体自体の比誘電率を推測することができる

[0045]

次に、図11に、混合体13の比誘電率の周波数依存性を調べた結果を示す。 試料としてBa(Nd,Bi)2Ti5〇14を使用し、粉体と空気とからなる混合体13における粉体の密度を変えた場合の個々の密度に対する混合体13の比誘電率を測定した。そして、周波数領域を0.1~6GHzまで変化させて混合体13の比誘電率を測定した。図11に示すように、この0.1~6GHzまでの周波数領域においては、混合体13の比誘電率は周波数に依存しないことがわかった。従って、第1の実施形態における同軸型導波路10を用いることにより、5GHz以外の周波数であっても、0.1~6GHzの間においては、5GHzで測定した場合と同様の結果を得ることが可能となる。

[0046]

次に、図2および図12を参照しつつ、異なる材料の粉体の比誘電率の大きさを相対比較する。まず、図2において混合体13における粉体の体積比率が、例えば「0.38」となる点の比誘電率を読み取る。その読み取った値を図12に示す。その結果、A12O3セラミックスの読み取った値は「2.7」となり、Ba(MgTa)O3セラミックスの読み取った値は「3.8」となり、TiO2セラミックスの読み取った値は「7.3」となった。比誘電率の大小関係は、小さい順に、A12O3セラミックス、Ba(MgTa)O3セラミックス、T

 $i\ O_2$ セラミックスという順になる。それに対して焼結品の比誘電率の大小関係も、小さい順に、A $I_2\ O_3$ セラミックス、B a (M g T a) O $_3$ セラミックス 、T $i\ O_2$ セラミックスという順になる。

[0047]

従って、本発明の方法によって得られた各粉体の比誘電率の大小関係は、焼結品の比誘電率の大小関係と一致するため、異なる材料の粉体の比誘電率の大小関係の相対比較を本発明の方法によって行うことができる。

[0048]

尚、本実施形態においては、対数混合則を適用して得られた結果を用いて相対 比較したが、本発明においてはそれに限られない。リヒトネッカロータの式また はウイナーの式を適用して得られた結果を用いて相対比較しても、同様の結果が 得られる。また、粉体の体積比率を「0.38」としたが、この値に限られず他 の体積比率を用いて比較しても同様の結果が得られる。

[0049]

[第2の実施の形態]

(構成)

次に、図13を参照しつつ、本発明の第2の実施形態において使用される導波 装置について説明する。同図に示されているように、第2の実施形態に使用され る導波装置には方形導波管型導波路20が用いられている。この方形導波管型導 波路20は、導体21によって構成されており、その導体21には断面が矩形状 の空隙22が形成されている。そして、測定対象となる粉体と、気体または液体 との混合体23はその空隙22に入れられることにより、方形導波管型導波路2 0の内部に充填される。尚、第2の実施形態においても、気体として空気を使用 した。従って、混合体23は、測定すべき粉体と空気とからなる。

[0050]

また、前述した第1の実施形態の同軸型導波路10と同様に、空気以外の気体または液体を使用して、その気体または液体と、粉体とからなる混合体23の比誘電率 ε を測定する場合は、その気体または液体が空隙22から流れ出さないように、方形導波管型導波路20にその気体または液体を保持するためのシール部

が設けられる。

[0051]

この第2の実施形態においても、前述した第1の実施形態と同様に、粉体として3種類のセラミックス材料(Al2O3セラミックス、Ba(MgTa)O3セラミックス、TiO2セラミックス)の粉体を用いて、各粉体と空気との混合体23を作製した。そして、前述した誘電特性測定装置100を用いて各粉体と空気との混合体23の比誘電率を測定した。また、前述した第1の実施形態の同軸型導波路10の測定結果と比較するために、Ba(Nd, Bi)2Ti5O14セラミックスについても測定した。この第2の実施形態においては、周波数が20GHzの電磁波を各混合体23に入射させ、その応答により比誘電率を測定した。そして、前述した第1の実施形態と同様に、混合体23における粉体の体積比率を変化させ、各混合体23の比誘電率を測定した。

[0052]

このようにして得られた粉体と空気との混合体23の比誘電率 ε が、前述した対数混合則、リヒトネッカロータの式またはウイナーの式に適用される。そして、この第2の実施形態で得られた比誘電率と、第1の実施形態で得られた比誘電率とを比較した。その比較した結果を図14に示す。図14は、この第2の実施形態の方形導波管型導波路20を用いて得られた混合体23の比誘電率と、第1の実施形態の同軸型導波路10を用いて得られた混合体13の比誘電率とを比較したグラフを表している。

[0053]

図14において、破線は第2の実施形態で使用された方形導波管型導波路20によって測定された混合体23の比誘電率を表している。一方、実線は第1の実施形態で使用された同軸型導波路10によって測定された混合体13の比誘電率を表している。図14に示すように、方形導波管型導波路20を用いて測定された各混合体の比誘電率は、同軸型導波路10を用いて測定された各混合体の比誘電率にほぼ一致しているのがわかる。従って、この第2の実施形態の方形導波管型導波路20を用いることにより、同軸型導波路10と比較して、さらに高周波領域においても粉体の比誘電率を測定することができる。また、前述した第1の

実施形態と同様に、この第2の実施形態においても、異なる粉体の比誘電率の大小を相対比較することが可能である。

[0054]

さらに、図15に示すような円形導波管型導波路30を用いて粉体の比誘電率を測定してもよい。この円形導波管型導波路30は、内部が空隙32になっている円筒型の外部導体31によって構成されている。そして、測定対象となる粉体と、液体または気体とからなる混合体33はその空隙32に入れられることにより、円形導波管型導波路30の内部に充填される。また、前述した第1および第2の実施形態の導波路と同様に、空気以外の気体または液体を使用して、その気体または液体と、粉体とからなる混合体33の比誘電率 を測定する場合は、その気体または液体が空隙32から流れ出さないように、円形導波管型導波路30にその気体または液体を保持するためのシール部が用いられる。

[0055]

そして、円形導波管型導波路30を用いることにより、前述した第1の実施形態と第2の実施形態と同様に、混合体33の比誘電率 ε を測定する。そして、前述した対数混合則、リヒトネッカロータの式またはウイナーの式をその実測値に適用することにより、各粉体の比誘電率を類推することができる。この円形導波管型導波路30によって得られた混合体の比誘電率を用いても、前述した第1の実施形態と同様に、異なる粉体の比誘電率の大小を比較することができる。

[0056]

【発明の効果】

本発明によると、分布定数回路が形成される導波路を用いて粉体と、気体また は液体とからなる混合体の比誘電率を測定することにより、数GHz以上の周波 数領域においても混合体の比誘電率を測定することができ、各粉体の比誘電率を 類推することが可能となる。

[0057]

さらに本発明の方形導波管型導波路を使用した粉体の比誘電率の測定方法によると、数十GHz以上の周波数領域においても粉体の比誘電率を測定することができるため、同軸型導波路と比較してさらに高い周波数領域で粉体の比誘電率を

測定することができる。

[0058]

さらに本発明によると、一定の混合比における混合体の比誘電率を算出することにより、異なる試料間の比誘電率の大小を相対的に比較することが可能となる

[0059]

さらに、本発明によると、導波路内に粉体と、気体または液体とからなる混合体を保持するシール部を備えることにより、粉体と、気体または液体とからなる混合体が導波路から漏れ出すことなく、混合体の比誘電率を測定することができる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

第1の実施形態において測定装置として使用される同軸型導波路10の斜視図である。

【図2】

第1の実施形態で測定された複合体13の比誘電率の実測値と、その実測値に 対数混合則を適用した結果を示すグラフである。

【図3】

第1の実施形態で測定された複合体13の比誘電率の実測値と、その実測値に リヒトネッカロータの式を適用した結果を示すグラフである。

【図4】

第1の実施形態で測定された複合体13の比誘電率の実測値と、その実測値に ウイナーの式を適用した結果を示すグラフである。

【図5】

第1の実施形態において、対数混合則を適用して粉体の比誘電率を算出するために用いるグラフである。

【図6】

第1の実施形態において、リヒトネッカロータの式を適用して粉体の比誘電率 を算出するために用いるグラフである。

【図7】

第1の実施形態において、ウイナーの式を適用して粉体の比誘電率を算出する ために用いるグラフである。

【図8】

第1の実施形態で測定された実測値に対数混合則を適用して得られた各粉体の 比誘電率を示す表である。

【図9】

第1の実施形態で測定された実測値にリヒトネッカロータの式を適用して得られた各粉体の比誘電率を示す表である。

【図10】

第1の実施形態で測定された実測値にウイナーの式を適用して得られた各粉体の比誘電率を示す表である。

【図11】

第1の実施形態に使用される同軸型導波路10を用いて、混合体の比誘電率の 周波数依存性について測定した結果である。

【図12】

第1の実施形態において、異なる材料の粉体の比誘電率の大きさを相対比較した表である。

【図13】

第2の実施形態において測定装置として使用される方形導波管型導波路20の 斜視図である。

【図14】

第1の実施形態の同軸型導波路10を用いて得られた粉体の比誘電率と、第2の実施形態の方形導波管型導波路20を用いて得られた粉体の比誘電率とを比較したグラフである。

【図15】

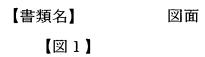
その他の実施形態の測定装置として使用される円形導波管型導波路30の斜視 図である。

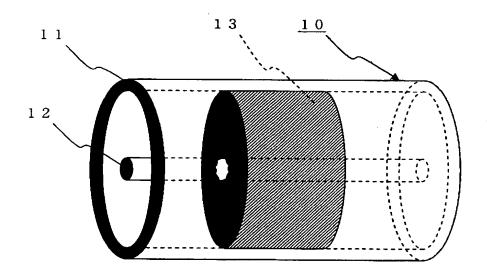
【図16】

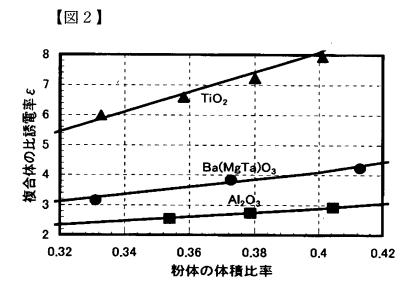
本発明の実施形態において使用される誘電特性測定装置100の構成を示したブロック図である。

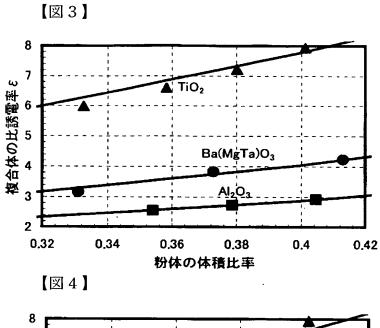
【符号の説明】

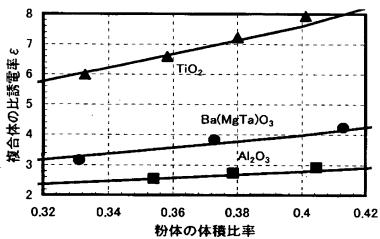
- 10 同軸型導波路
- 11、31 外部導体
- 12 中心導体
- 13、23、33 混合体
- 20 方形導波管型導波路
- 2 1 導体
- 22、32 空隙
- 30 円形導波管型導波路
- 100 誘電特性測定装置
- 101 導波装置
- 102 測定手段
- 103 ネットワークアナライザー
- 104 演算処理装置

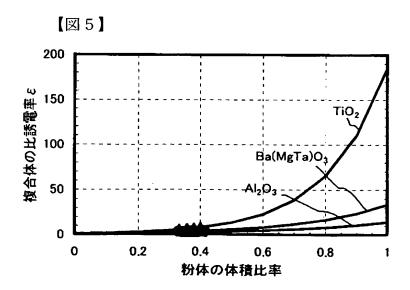


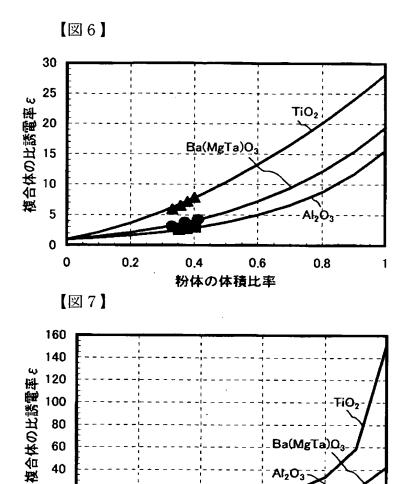












0.6

粉体の体積比率

8.0

【図8】

0

40 20 0

種類	焼結品の比誘電率	測定値
Al ₂ O ₃	11	14.1
Ba(MgTa)O ₃	24	33.9
TiO ₂	104	185.8

0.4

0.2

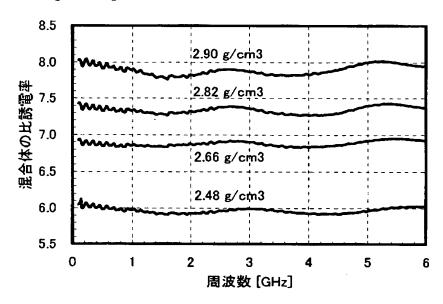
【図9】

種類	焼結品の比誘電率	測定值
Al ₂ O ₃	11	15.7
Ba(MgTa)O ₃	24	19.4
TiO ₂	104	28.2

【図10】

種類	焼結品の比誘電率	測定值
Al ₂ O ₃	11	8.75
Ba(MgTa)O ₃	24	42.7
TiO ₂	104	152.3

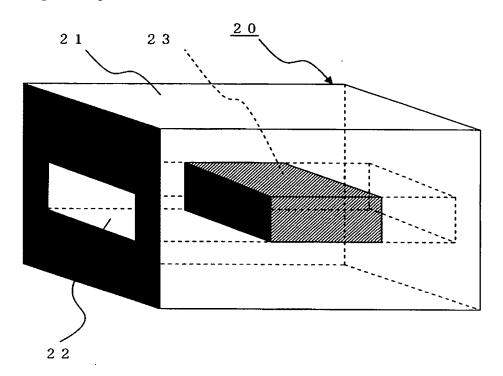
【図11】



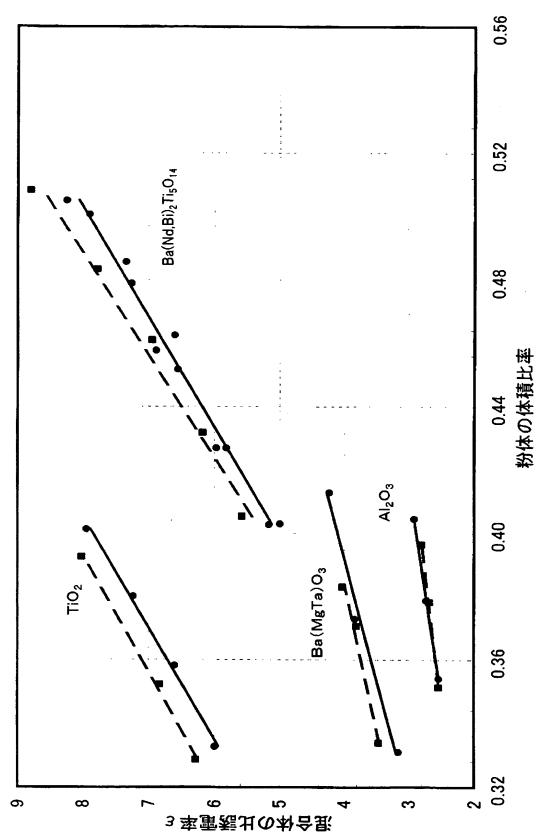
【図12】

種類	焼結品の比誘電率	粉体の体積比が0.38のとき の混合体の比誘電率
Al ₂ O ₃	11	2.7
Ba(MgTa)O ₃	24	3.8
TiO ₂	104	7.3

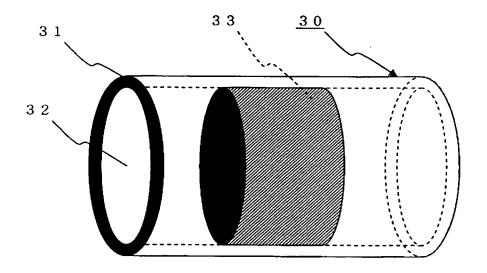




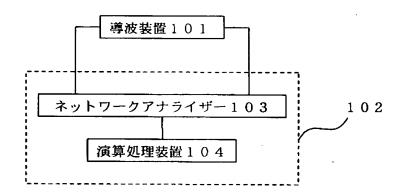




【図15】



【図16】



【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 数GHz以上の高い周波数においても粉体の比誘電率を測定することができる方法を提供するものである。

【解決手段】 同軸型導波路10は、内部が空洞となっている円筒型の外部導体11と、その外部導体11の内部の中心部分に配置されている円柱状の中心導体12とから構成されている。粉体と空気の混合体13は、外部導体11と中心導体12との間に入れられることにより、同軸型導波路10の内部に充填される。混合体13における粉体の体積比率を変化させ、数GHz以上の周波数を有する電磁波を各混合体13に入射させることにより、各混合体13の比誘電率を測定する。そして、対数混合則などの式を用いて粉体の比誘電率を算出する。

【選択図】 図1

特願2003-096424

出願人履歴情報

識別番号

[000003067]

1. 変更年月日

1990年 8月30日

[変更理由]

新規登録

住 所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 ティーディーケイ株式会社

2. 変更年月日

2003年 6月27日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区日本橋1丁目13番1号

氏 名 TDK株式会社

This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning Operations and is not part of the Official Record

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

BLACK BORDERS

IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

FADED TEXT OR DRAWING

BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

SKEWED/SLANTED IMAGES

COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

GRAY SCALE DOCUMENTS

LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

OTHER: ____

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.